受動性に基づく磁気浮上系の非線形制御

A Nonlinear Passivity-based Control of Magnetic Suspension Systems

滑川 徹 (長岡技術科学大学) ○ 河野 洋人 (長岡技術科学大学)

Toru NAMERIKAWA, Nagaoka University of Technology, Kamitomioka 1603-1, Nagaoka, Niigata Hiroto KAWANO, Nagaoka University of Technology

Key Words: Passivity, Magnetic Suspension System, Nonlinear Control

1. はじめに

磁気浮上技術は電磁力によって対象を非接触支持する技術で 幅広い分野で応用されている.この磁気浮上系は不安定かつ強 い非線形性を有しているのが特徴である.これまでの研究の多 くは磁気浮上系を線形近似し,線形制御則を導出することで平 衡点近傍での安定浮上を実現している.しかし磁気浮上系は本 来,非線形であるため線形制御則を用いたコントローラでは浮 上体の浮上量を幅広く取ることは困難である.本研究では磁気 浮上系をより幅広い領域で安定浮上させるために Ortega ら⁽¹⁾ や清水ら⁽²⁾の手法を使い,磁気浮上系の有する受動性を用いて 非線形コントローラを導出し,その有効性を検証する.

2. 磁気浮上系モデルと受動性⁽¹⁾⁽²⁾

2.1 磁気浮上系モデル



Fig. 1 Magnetic Suspension System

本研究では Fig. 1 に示すような磁気浮上系を考える. 浮上体 の位置は定常位置 X からの距離 x で表し,鉛直下向きを正とす る.また,浮上体の質量を M とする.電磁石の内部抵抗を R, 電磁石に印加する電圧を u,流れる電流を i とする. F は電磁力 である.電磁石のインダクタンス L は x の関数として

$$L(x) = \frac{2k}{x_0 + X + x(t)} + L_0 \tag{1}$$

のように書ける. ここでkは吸引力係数, x_0 は補正項, L_0 は漏 れインダクタンスである. ただしここでは,漏れインダクタン スは小さいとし, $L_0 = 0$ と仮定する. このときシステムの電気 回路方程式は (2) 式となり,運動方程式は (3) 式となる.

$$L(x)\dot{i} - \frac{2k}{(x_0 + X + x)^2}\dot{x}i + Ri = u$$
(2)

$$M\ddot{x} + \frac{k}{(x_0 + X + x)^2}i^2 - Mg = 0$$
(3)

ここで次式の磁束 λ は次式のように書くことができる.

$$\lambda = L(x)i = \frac{2k}{x_0 + X + x}i\tag{4}$$

この磁束λを用いると運動方程式は次式のようになる.

$$\Sigma: \begin{cases} \dot{\lambda} = -\frac{R}{2k}(x_0 + X + x)\lambda + u\\ F = \frac{1}{4k}\lambda^2\\ M\ddot{x} = Mg - F \end{cases}$$
(5)

このとき, 磁気浮上系 Σ は強受動的な電気系サブシステム $\Sigma_1: u \to \lambda$ と受動的な機械系サブシステム $\Sigma_2: (Mg - F) \to \dot{x}$ に分割でき, Fig. 2 に示すように, 磁気浮上系 Σ はこれらを フィードバック結合した系と見なすことができる.



Fig. 2 Feedback Decomposition

2.2 磁気浮上系の受動性⁽³⁾

受動性の定義について述べる.次の非線形システムを考える.

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u\\ y = h(x) \end{cases}$$
(6)

ただし $u \in R^m$ は入力, $y \in R^m$ は出力, $x \in R^n$ は状態である. 受動的であるとは、ストレージ関数 H(x) が存在し消散不等式

$$H(x(t)) - H(x(0)) \le \int_0^t y^T(\tau)u(\tau)d\tau, \quad \forall t \ge 0$$
 (7)

が任意の入力 u に関して成り立つことである $(H(x) \ge 0)$.

磁気浮上系の受動性について検証する.まず電気系サブシス テム Σ_1 について *H* の候補を $H = \frac{1}{2}\lambda^2$ とする. *H* を時間微分 し, $\alpha = R/2k > 0$ とおき, $x_0 + X + x > 0$ から

$$\dot{H} = \lambda \dot{\lambda} \le -\alpha \lambda^2 + \lambda u \tag{8}$$

の関係となり上式の両辺を0からTまで時間積分すれば

$$\int_{0}^{T} \lambda u dt \ge \alpha \int_{0}^{T} \lambda^{2} dt + H(T) - H(0)$$
(9)

が成立し、 Σ_1 がエネルギ供給率を $w(\lambda, u) = \lambda u - \alpha \lambda^2$ とする 出力強受動系であることを示している.

次に機械系サブシステム Σ_2 の受動性について検証する. Σ_2 の H の候補を $H = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$ とし、時間微分して次式を得る.

$$\dot{H} = M\dot{x}\ddot{x} = \dot{x}(Mg - F) \tag{10}$$

上式の両辺を0からTまで時間積分すれば次式が成立する.

$$\int_{0}^{T} \dot{H}dt = H(T) - H(0) = \int_{0}^{T} \dot{x}(Mg - F)dt$$
(11)

このため Σ_2 はエネルギ供給率を $w(\dot{x}, Mg - F) = \dot{x}(Mg - F)$ とする受動系である.

3. コントローラ⁽¹⁾⁽²⁾

受動性を有するシステムはシンプルなフィードバックで安定 化可能である.本研究では電気系サブシステムと機械系サブシ ステムに対し,独立にコントローラを設計し,それらを結合させ ることで.磁気浮上系のコントローラを構成する.

3.1 制御入力 *u* の決定

機械系サブシステムが x を整定するために必要な電磁力 F_d と、それを発生させる目標磁束 λ_d が与えられているものとし て、 $\lambda \rightarrow \lambda_d$ となるような制御入力 u を決定する. 電気系サブシ ステムのエネルギを整形し、所望する閉ループ系のストレージ 関数が次式となるようなコントローラを考える ($\tilde{\lambda} = \lambda - \lambda_d$).

$$H_d = \frac{1}{2}\tilde{\lambda}^2 \tag{12}$$

いま,入力 u を次式のように置くと

$$u = \dot{\lambda}_d + \frac{R}{2k}(x_0 + X + x)\lambda_d + v \tag{13}$$

Σ1 に関する誤差系のダイナミクスは(5)の第1式と(13)式より

$$\dot{\tilde{\lambda}} = -\frac{R}{2k}(x_0 + X + x)\tilde{\lambda} + v \tag{14}$$

となる. このとき, 誤差系 (14) 式はストレージ関数を (12) 式, エネルギ供給率を $w(\tilde{\lambda}, u) = \tilde{\lambda}u - \alpha \tilde{\lambda}^2$ とし,入力を v,出力を $\tilde{\lambda}$ とする出力強受動系となる. また, $v \equiv 0$ のとき $\alpha = R/2k > 0$, $x_0 + X + x > 0$ より誤差系 (14) は指数安定で $t \to \infty$ のとき $\lambda \to \lambda_d$ となることが保証される.

3.2 目標磁束 λ_d の決定

電磁力 F は、 $\lambda = \lambda - \lambda_d$ より次式のように書ける.

$$F = \frac{1}{4k} \left\{ \lambda_d^2 + \tilde{\lambda} \left(\tilde{\lambda} + 2\lambda_d \right) \right\}$$
(15)

 $v \equiv 0$ のとき $\tilde{\lambda} \to 0$ が保証されているので,目標磁束 $\lambda_d \varepsilon$ (15) 式の $\tilde{\lambda} = 0$, $F = F_d$ とした式の解として以下のように与える.

$$\lambda_d = \sqrt{4kF_d} \qquad \dot{\lambda}_d = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{4k}{F_d}}\dot{F}_d \qquad (16)$$

ここで、目標電磁力 F_d の時間微分は既知であると仮定し、 $\lambda_d < 0$ となる解は用いない.このとき、(13)式に(16)式を代入すれば 制御則 uは F_d と \dot{F}_d を用いて次のように書ける.

$$u = \sqrt{\frac{k}{F_d}} \dot{F}_d + R(x_0 + X + x) \sqrt{\frac{F_d}{k}} + v$$
 (17)

3.3 目標電磁力 *F*_d の決定

最後に機械系サブシステムをxに整定させるための目標電磁 カ F_d を決定する.ここでは PID 制御則を用いて目標電磁力 F_d を以下のように定義する ($\tilde{x} = x - x_*$ は位置誤差).

$$F_d = -M\{\ddot{x}_* - k_d\dot{\tilde{x}} - k_p\tilde{x} - k_i\int_0^t \tilde{x}(\tau)d\tau\}$$
(18)

 $k_p, k_i, k_d > 0$ は次式がフルビッツ多項式となるように与える.

$$d(s) = s^3 + k_d s^2 + k_p s + k_i \tag{19}$$

Fig. 3 に導出したコントローラのブロック線図を示す. 図中の C_1 は (17)式に対応し, C_2 は (18)式に対応する.

3.4 コントローラの安定性

コントローラは磁気浮上系モデル (5) に対し, $v \equiv 0$ としたコ ントローラ (17),(18) を適用した場合, $t \to \infty$ のとき $\tilde{x} \to 0$ と なり,安定性が保証される⁽¹⁾⁽²⁾.



Fig. 3 Block diagram.

4. シミュレーション

設計したコントローラの有効性を検証するためにシミュレー ションを行った.使用したパラメータはM = 0.286[kg], $k = 2.14 \times 10^{-4}$ [Nm²/A²], $x_0 = 4.36 \times 10^{-3}$ [m], $L_0 = 0.248$ [H],R = 9.49[Ω] である.X = 0.003, 0.01, 0.1[m] で1[mm] の目標値応答を行い,広い動作領域での安定性を検証する.またモデル変動に対する検証のためM = 286, 458, 572[g] に対してX = 3[mm] で目標値応答を行いその性能を検証する.通常の PID 制御と今回設計した非線形コントローラでシミュレーションを行い,その結果を比較する.



Fig. 4 を見ると定常浮上位置 X の変化に対して線形の PID 制御では応答が悪化しているのに対して,非線形コントローラで はほとんど応答に変化がなく良好な応答結果が得られ,広い動 作領域で安定性と性能を維持していることが分かる.また Fig. 5 を見ると質量 M の変動に対しても線形の PID 制御では応答 が悪化しているのに対して,非線形コントローラではほとんど 応答に変化がなく良好な応答結果が得られた.

5. おわりに

本研究では受動性に基づいたコントローラを設計し、シミュ レーションを行い、その有効性を検証した.その結果動作点変 動やモデル変動に対して安定性で性能を補償していることが分 かった.今後は実際に制御実験による検証を行う.

文 献

- R. Ortega, A. Loria, P. J. Nicklasson and H. Sira-Ramirez, "Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems," Springer, 1998.
- (2) 清水年美,佐々木実,"磁気浮上系に対する受動性をもとにした電流フィードバックを用いない非線形制御,"日本機械学会論文集(C編),68巻675号,pp.156-161,Nov. 2002.
- (3) 申鉄龍, "受動性設計の基礎," 計測と制御, 第43巻, 第5号, pp. 447-453, May 2004.